

穿透式電子顯微鏡 (FEI Tecnai™ G2 F-20 S-TWIN FEG-TEM)

儀器自行操作管理辦法

自行操作申請資格:

- (1)不限校內碩、博士班學生。
- (2)不限每間實驗室人數。
- (3)學期中正在修本校於研究所開設之電子顯微鏡課程學分者(上學期:材料系 陳詩芸教授開設之穿透式電子顯微鏡,下學期:機械系 周振嘉教授開設之電子顯微鏡擇一)優先考慮。
- (4)已有其他TEM機台操作經驗者,可直接向技術員申請考核。
- (5)穿透式電子顯微鏡 (FEI Tecnai™ G2 F-20 S-TWIN FEG-TEM) 機台訓練課程報名表中指導教授欄位,需請教授親自簽名認可。

↓ 申請訓練

- (1)初學者經技術員(或助教)訓練 10 次時段(以上)(包括 TEM模式下之影像、繞射及成分分析;STEM模式下之影像及成分分析)。
- (2)1~2 次/1 星期、一梯次約 2~3 人(訓練費用,一律利用國科會基礎研究核心設施預約服務管理系統扣款)。
- (3)訓練過程,繳交儀器訓練手冊。

↓ 申請協同操作

限預約技術人員(或助教)時段練習。

↓ 申請考核

隨時皆可自行操作認證檢測(需預約時段)。

↓ 通過者取得使用執照

- (1)不通過至少隔一週才可再補考。
- (2)1 個月沒使用,請重新考核。

※可預約本儀器任何自行操作時段,並需擔任助教,協同校內外委託服務工作。